

EVG signs a contract with PMT to supply 'LITHOSCALE maskless lithography system' - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. “We can achieve significant cost savings, faster process development, and improved process performance, by switching from traditional lithography to EV Group’s LITHOSCALE maskless exposure product. We look forward to future collaborations with EVG leveraging LITHOSCALE and other process solutions for advanced probe card manufacturing.” stated Dr. Yong-Ho Cho, CEO of PMT. According to Young-Sik Yun, general manager of EV Group Korea, “Wafer-level testing with probe cards is an essential process for improving device production yields and reducing overall test cost per die. LITHOSCALE offers a unique combination of high resolution, high flexibility to handle many different product designs, and low cost of ownership, making it an ideal solution for manufacturing fine-pitch wafer probe cards.”



☰ 뉴스 인물·기업 기획특집 테크가이드 제품가이드 컨퍼런스 테크라이브러리 웨버나

HOME > 뉴스 > 반도체소부장

EVG, 피엠티와 '리소스케일 마스크리스 노광 시스템' 공급 계약

김정욱기자 | 승인 2024.01.24 10:54 | 댓글 0



조용호 피엠티 대표(좌)와 윤영식 EVG 한국지사장(우)

[데이티넷] EVG(EV Group)는 반도체 웨이퍼 프로브 카드 선도 기업 피엠티(대표 조용호)와 리소스케일(LITHOSCALE) 마스크리스 노광 시스템 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약으로 EVG의 리소스케일 시스템은 충남 아산의 피엠티 본사에 설치돼 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리(HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트용 자세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

피엠티 조용호 대표는 “미세 피치 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패터닝 공정을 통해 제작돼 제조 비용 증가 최소화가 필요하다”며 “기존의 마스크 얼라이너를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스 노광 장비인 리소스케일로 대체해 비용 절감이 가능하고, 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 단축 가능할 뿐 아니라 프로세스 성능도 향상될 것”이라고 전했다.

EVG의 MLE(Maskless Exposure) 기술을 적용한 리소스케일은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다. 특히 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프로세싱 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 결합해 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다.

EVG 윤영식 한국지사장은 “프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수율을 높이고 다이당 전반적인 테스트 비용을 낮추기 위한 필수 공정이다”며 “리소스케일은 높은 분해능, 다양한 제품 설계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 총소유비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 이상적이다”고 말했다.